

# MPI TS200 | 200 mmマニュアル・プローバー DC/CV、RF測定用マニュアル・プローバー

## 顕微鏡マウントおよび移動機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- リニアリフト (構成変更が容易に)
- 25×25 mm エア・ベアリング機構 もしくは 50×50 mm XYリニア機構(オプション)

## 高さ調整機構付プラテン機構

- マイクロメーターにて微調整
- 20 mmの調整範囲

## プローブ・プラテン

- 高剛性・安定設計
- DC/CV、RF測定用設計
- RFポジショナ用角型調整器
- すぐれた熱安定性 設計

## 独自のプラテンリフト

- コンタクト、コンタクト・セパレーション(300 μm)、ロード(3 mm)の3つの独立したポジショニング
- セーフティー・ロック機能
- ±1 μmの再現性をもつ高コンタクト精度「オート・コンタクト」

## RFキャリブレーション

- 校正基板用2つの補助チャック
- 高精度な校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 μm(高コンタクト精度)

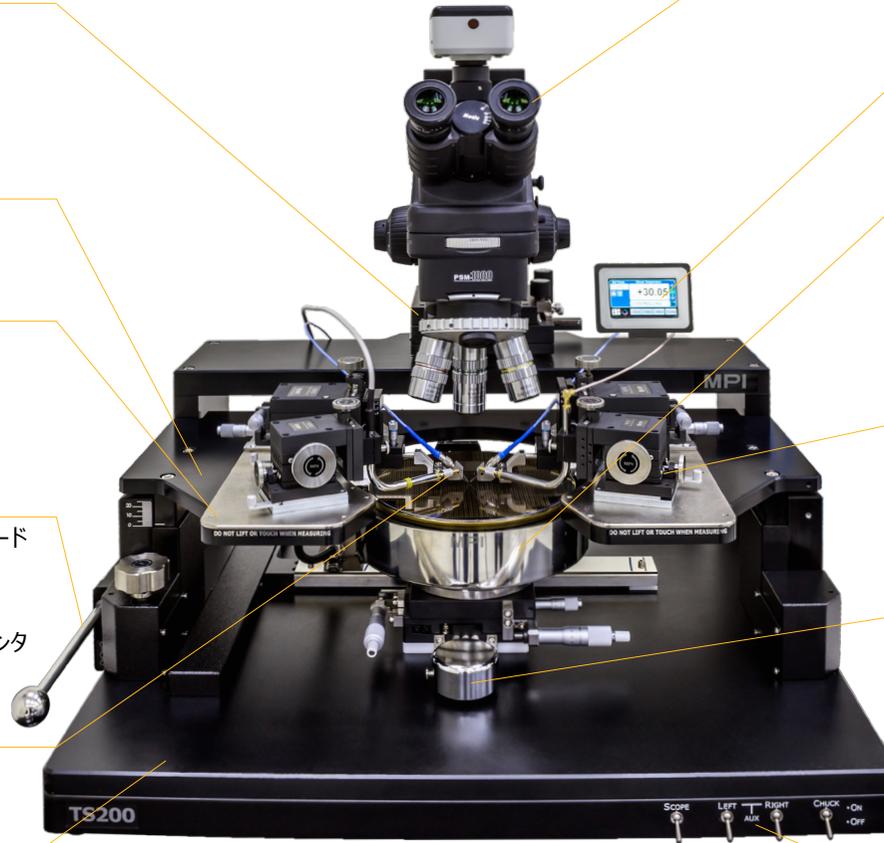
## 小型な設計

- 作業台におけるベース・プレート
- 振動吸収アブソーバ・ベース
- 省スペース設計

## \*\*\*オプション\*\*\*

- 防振台
- EMIシールド付暗箱
- 真空ポンプ / エア・コンプレッサ

- 作業台 (温度コントローラ用ラック、パソコン、キーボード・トレイ付)  
※オプションにてデュアル・モニター・スタンド、計測器トレイが取付可能)



## 顕微鏡及び顕微鏡オプション

- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI実体顕微鏡ST45/MPI単眼鏡筒SZ10/MZ12(12倍ズーム、作動距離95 mm)
- 高倍率顕微鏡 FS70/PSM-1000
- パソコンいらずのHDMI接続差端子付きCCDカメラ

## 温度チャックインテグレーション

- タッチパネル式の温度コントローラにより操作的に非常に便利な設計

## モジュール式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- 300℃までの各種温度範囲より選定可能
- フィールドにてアップグレード可能
- センター(小さな被測定物)、小ウェハーとの切替が簡単

## DCおよびRFポジショナ

- 最大RF 4台またはDC 10台まで搭載可能
- さまざまなポジショナより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビン、RFアームのラインアップ

## チャック XY/θステージ機構

- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 240 x 315 mmステージ移動範囲
- 25 mm×25 mm精度のXY/θマイクロメータ機構
- < 1.0 μm 精度 @ 500 μm/解像度
- ロードが簡単な広いY軸設計
- ±5°θ微調整機構

## 真空制御を前面に設置

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記